

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成18年3月9日(2006.3.9)

【公開番号】特開2005-259706(P2005-259706A)

【公開日】平成17年9月22日(2005.9.22)

【年通号数】公開・登録公報2005-037

【出願番号】特願2005-107006(P2005-107006)

【国際特許分類】

H 01 J 37/28 (2006.01)

G 01 N 23/225 (2006.01)

H 01 J 37/20 (2006.01)

H 01 J 37/30 (2006.01)

H 01 J 37/317 (2006.01)

【F I】

H 01 J 37/28 B

G 01 N 23/225

H 01 J 37/20 A

H 01 J 37/30 Z

H 01 J 37/317 D

【手続補正書】

【提出日】平成18年1月20日(2006.1.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

試料を載置する試料台と；

微小試料を支持できるマニピュレータと；

微小試料を固定できる第2試料台と；

試料台、及び第2試料台が配置された試料室と；

試料台に載置された試料、及び第2試料台に固定された微小試料にイオンビームを照射できる集束イオンビーム光学系と；

第2試料台に固定された微小試料に電子ビームを照射できる電子ビーム光学系と；を備え、

第2試料台に固定された微小試料が、イオンビーム及び電子ビームに対して所定の角度となるよう、第2試料台の角度を制御できるように構成された微小試料加工観察装置。